

К ТЕОРИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

А. В. Гайнер, Г. В. Кривошеков и Р. И. Соколовский

Построена теория преобразования изображения в нелинейных оптических системах, использующая аппарат функций Грина. Показано, что нелинейный преобразователь эквивалентен системе из большого числа преломляющих поверхностей, излучающих когерентно. В качестве примера вычислены геометрические aberrации преобразователя, работающего по схеме «касательного синхронизма».

Сложение частот в оптически нелинейных средах позволяет переводить инфракрасное изображение в видимую область. Существует несколько схем преобразователей, отличающихся геометрией поля накачки (плоская, сферическая, цилиндрическая волны) и принципом работы [1-10]. В параксиальном приближении построена теория формирования видимого изображения [3-8]. Вопрос об aberrациях нелинейных оптических систем в литературе не рассматривался. Следует отметить, что даже в схеме «касательного синхронизма» [1, 2] aberrации, вообще говоря, существенны и в некоторых случаях определяют разрешающую способность прибора.

В настоящей работе предлагается теория формирования изображения, основанная на методе функции Грина и позволяющая выйти за рамки параксиальной оптики. В качестве примера вычисляются aberrации преобразователя, работающего по схеме «касательного синхронизма».

Для простоты расчетов пренебрежем двулучепреломлением, отражением и преломлением на гранях кристалла и ограничимся приближением заданного поля по накачке и инфракрасному излучению, а также скалярной теорией распространения волн [11]. С учетом этих приближений поле суммарной частоты E_s в точке наблюдения R_s дается формулой

$$E_s(R_s) = \gamma \int_V d^3R_V E_p(R_V) E_{ir}(R_V) r_s^{-1} e^{ik_s r_s}, \quad (1)$$

где $r_s = R_s - R_V$, $r_s^{-1} e^{ik_s r_s}$ — функция Грина волнового уравнения, γ — нелинейная константа, E_p , E_{ir} — напряженности полей накачки и инфракрасного излучения соответственно. Интегрирование в (1) идет по объему V нелинейного кристалла.

Представим поле накачки в виде

$$E_p(R_V) = A_p(R_V) e^{ik_p \Phi_p(R_V)},$$

где $A_p(R_V)$ — медленно меняющаяся по сравнению с фазой $\Phi_p(R_V)$ функция, k_p — длина волнового вектора накачки. Разобьем объем кристалла на бесконечно тонкие слои, по форме совпадающие с поверхностями постоянной фазы накачки $\Phi_p(R_V) = \text{const}$, и выберем в формуле (1) следующий порядок интегрирования: сначала интегрируем по фазовой поверхности накачки, затем суммируем излучение от всех поверхностей. Для

сферической инфракрасной волны с центром в точке R_{ir} , формула (1) примет вид

$$E_s(\mathbf{R}_s) = g \int dz_V e^{ik_p \Phi_p(z_V)} \int_{\sigma_V} d^2z_V A_p(\sigma_V) \frac{e^{i[k_{ir}r_{ir} + k_s r_s]}}{r_{ir} r_s}, \quad (2)$$

где $r_{ir} = R_V - R_{ir}$; g — параметр, характеризующий интенсивность инфракрасной волны и нелинейность кристалла; z_V — координата пересечения фазовой поверхности накачки с осью z ; σ_V — координаты точки на этой поверхности.

Интеграл по σ_V в формуле (2) по форме совпадает с интегралом Френеля—Кирхгофа [11] для преломляющей поверхности $\Phi_p(\mathbf{R}_V) = \text{const}$ с показателем преломления $n = k_s/k_{ir}$. Таким образом, нелинейный кристалл ведет себя как система непрерывно расположенных вдоль оси z и когерентно излучающих поверхностей с апертурными диафрагмами с амплитудными прозрачностями $A_p(\sigma_V, z_V)$.

Нелинейный преобразователь вносит в изображение искажения двух типов. Первое — аберрации каждой преломляющей поверхности и дифракция на ней. Второе — размытие, носящее характер неустранимой дефокусировки и связанное с тем, что изображение формируется большим числом преломляющих поверхностей, каждая из которых дает изображение в своем месте.

Рассмотрим случай, когда для каждой преломляющей поверхности справедливо приближение геометрической оптики. Тогда излучение суммарной частоты представляет собой совокупность интерферирующих лучей.

Выберем накачку в виде плоской волны, распространяющейся вдоль оси z

$$E_p(\mathbf{R}_V) = A_p e^{ik_p z_V}.$$

Координаты ρ_s пересечения луча, который преломился в точке ρ_V плоскости, находящейся на расстоянии z_V от начала координат с плоскостью наблюдения z_s , даются формулой

$$\rho_s = \rho_{ir} \frac{|z_s - z_V|}{nr} + \rho_V \left[1 - \frac{|z_s - z_V|}{nr} \right],$$

где

$$r^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) (\rho_V - \rho_{ir})^2 + (z_V - z_{ir})^2,$$

ρ_{ir} , ρ_s , ρ_V — поперечные, z_{ir} , z_s , z_V — продольные координаты источника, точки наблюдения и элемента кристалла соответственно. Фаза луча, прошедшего в точку \mathbf{R}_s и преломившегося в точке \mathbf{R}_V ,

$$\Phi(\mathbf{R}_{ir}, \mathbf{R}_s, \mathbf{R}_V) = k_p z_V + k_{ir} r_{ir} - k_s r_s. \quad (3)$$

Последний член в (3) входит с минусом, так как изображение находится в мнимом пространстве.

Рассмотрим параксиальное приближение

$$\frac{\Delta \rho_V}{z_V - z_{ir}} \ll 1, \quad \frac{\Delta \rho_V}{z_V - z_s} \ll 1 \quad (z_V \geq 0, \quad z_{ir} \leq 0, \quad z_s \leq 0),$$

где $\Delta \rho_s = \rho_s - \rho_{ir}$, $\Delta \rho_V = \rho_V - \rho_{ir}$. Тогда можно положить

$$\Delta \rho_s = \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) z_V + \frac{1}{n} z_s - z_{ir}}{z_V - z_{ir}} \Delta \rho_V, \quad (4)$$

$$\Phi = \Phi_0 + (k_p + k_{ir} - k_s) z_V + \frac{k_{ir}}{2} \left[\frac{\Delta \rho_V^2}{z_V - z_{ir}} - n \frac{(\Delta \rho_V - \Delta \rho_s)^2}{z_V - z_s} \right], \quad (5)$$

где $\Phi_0 = -k_{ir} z_{ir} + k_s z_s$.

В случае «касательного синхронизма» второй член в формуле (5) равен нулю. Из формул (4), (5) видно, что в точку $\Delta\rho_s=0$ все лучи приходят в фазе. Следовательно, поперечные координаты параксиального изображения совпадают с поперечными координатами инфракрасного источника. Из вышеизложенного следует, что даже в параксиальном приближении имеет место неустраняемая дефокусировка. Поэтому в качестве плоскости параксиального изображения выберем ту плоскость наблюдения, в которой дефокусировочное размытие минимально. Процедура нахождения размытия состоит в следующем. Из уравнения (4) находим связь между продольным и поперечными координатами элементов кристалла, дающих лучи в точку наблюдения $\Delta\rho_s$.

Теперь можно выразить фазу лучей, приходящих в эту точку, как функцию только от z_V . Считается, что если при z_V , пробегающем длину кристалла, фаза колеблется в пределах π , точка наблюдения находится в пределах светлого пятна. Размер этого пятна оказывается минимальным в плоскости

$$z_s = nz_{ir} - (n-1)\frac{L}{2}, \quad (6)$$

где L — толщина нелинейного кристалла. В этой плоскости величина размытия Δ определяется формулой

$$\Delta^2 = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{L}{k_{ir}}. \quad (7)$$

Легко видеть, что величина размытия Δ не изменится, если на переднюю грань кристалла наложить диафрагму с размерами большими, чем D

$$\left(\frac{D}{z_{ir}}\right)^2 = \frac{2\pi}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)k_{ir}L}. \quad (8)$$

Резюмируя, можно сказать, что в параксиальном приближении нелинейный кристалл эквивалентен преломляющей плоскости с показателем преломления $n = k_s/k_{ir}$, расположенной в центре кристалла с апертурной диафрагмой диаметром D . При этом размытие Δ по порядку величины совпадает с размером дифракционного пятна при дифракции инфракрасного излучения на диафрагме D .

Перейдем к рассмотрению геометрических aberrаций. Рассмотрим тонкий кристалл и разложим фазу в ряд по параметрам z_V/r_{ir} и z_V/r_s , ограничиваясь линейными членами разложения

$$\Phi = \Phi'_0 + \Delta k(z_s, z_{ir}, \Delta\rho_V)z_V, \quad (9)$$

где

$$\Phi'_0 = k_{ir}r'_{ir} - k_s r'_s, \quad \Delta k = k_p + k_{ir} \cos \Theta_{ir} - k_s \cos \Theta_s, \quad \cos \Theta_{ir} = \frac{|z_{ir}|}{r'_{ir}},$$

$$\cos \Theta_s = \frac{|z_s|}{r'_s}, \quad r'_{ir} = \sqrt{\Delta\rho_V^2 + z_{ir}^2},$$

$$r'_s = \sqrt{(\Delta\rho_V - \Delta\rho_s)^2 + z_s^2}.$$

Это приближение справедливо при условии

$$k_{ir}z_{ir} \left(\frac{L}{z_{ir}}\right)^2 \ll \pi. \quad (10)$$

Ниже будет видно, что условие (10) выполняется всегда, когда aberrационное размытие превосходит неустраняемую дефокусировку. Из формулы (9) видно, что существенный вклад в изображение будет давать центральная часть кристалла, ограниченная диафрагмой с диаметром D_a определяемым условием

$$\Delta k(z_s, z_{ir}, D_a)L = \pi. \quad (11)$$

Условие (11) по форме совпадает с выражением для угловой ширины главного максимума синхронизма для взаимодействующих в нелинейном кристалле плоских волн. Однако оно написано для лучей и справедливо только для тонких кристаллов. При $D_a/z_{ir} \ll 1$ условие (11) принимает вид

$$\left(\frac{D_a}{z_{ir}}\right)^2 = \frac{2\pi}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)k_{ir}L}. \quad (12)$$

Тогда размер абберационного размытия определяется формулой

λ_{ir} , мкм	L , мм	d_a , мм	z_a , см
1	10	$2 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^4$
10	10	$6 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^3$
1	1	6.10	$2 \cdot 10^2$
10	1	2.10	2.10
1	10^{-1}	2	2
10	10^{-1}	$6 \cdot 10^{-1}$	$2 \cdot 10^{-1}$

$$\Delta_a = \frac{1}{2} \frac{n+1}{n-1} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} \left(\frac{2\pi}{k_{ir}L}\right)^{3/2} z_{ir}. \quad (13)$$

Сопоставляя формулы (7) и (13), приходим к выводу, что абберационное размытие превосходит неустранимую дефокусировку при $z_{ir} > z_a$, где

$$z_a = \frac{n-1}{n+1} \frac{1}{2\pi} k_{ir}L^2. \quad (14)$$

Из (14) видно, что (10) выполняется всюду, где абберации существенны. При этом абберации превосходят дифракционное размытие, когда поперечный размер кристалла больше d_a , где $d_a^2 = \frac{n(n-1)}{(n+1)^2} \frac{1}{2\pi} k_{ir}L^3$.

В таблице приведены значения d_a и z_a , для разных длин волн и разных кристаллов.

Абберационные кривые совпадают с соответствующими кривыми для плоского преломляющего слоя, но в отличие от последних размыты на величину порядка размера неустранимой дефокусировки (абберационные полосы).

Литература

- [1] J. E. Midwinter. Appl. Phys. Lett., 12, 68, 1968.
- [2] J. Warner. Appl. Phys. Lett., 13, 360, 1968.
- [3] H. Firester. J. Appl. Phys., 40, 4842, 1969.
- [4] H. Firester. J. Appl. Phys., 41, 703, 1970.
- [5] Э. С. Воронин, М. И. Дивликеев, Ю. А. Ильинский, В. С. Соломатин. ЖЭТФ, 58, 51, 1970.
- [6] R. A. Andrews. IEEE, QE-5, 548, 1969.
- [7] R. A. Andrews. IEEE, QE-6, 68, 1970.
- [8] W. Chiou. J. Appl. Phys., 42, 1985, 1971.
- [9] H. Firester. Appl. Opt., 9, 2266, 1970.
- [10] А. В. Гайнер, Г. В. Кривошеков, С. В. Круглов, С. И. Маренников, П. А. Чаповский. Сб. «Нелинейные процессы в оптике». Изд. «Наука», Новосибирск, 1970.
- [11] М. Борн. Основы оптики. Изд. «Наука», М., 1970.

Поступило в Редакцию 28 июня 1971 г.